

【19】中華民國

【12】專利公報 (B)

【11】證書號數：I286578

【45】公告日：中華民國96(2007)年9月11日

【51】Int. Cl. :
C23C14/56 (2006.01)
H01L21/66 (2006.01)

C23C16/54 (2006.01)
G01N21/00 (2006.01)

發明 全 4 頁

【54】名稱：連續式鍍膜設備之線上自動化檢測系統

【21】申請案號：094124770

【22】申請日：中華民國94(2005)年7月21日

【11】公開編號：200704811

【43】公開日：中華民國96(2007)年2月1日

【72】發明人：許耿禎 SHEU, GEENG JEN

【71】申請人：修平技術學院 HSIUPING INSTITUTE OF TECHNOLOGY
臺中縣大里市工業路11號

【74】代理人：劉緒倫

1

2

[57]申請專利範圍：

1.一種連續式鍍膜設備之線上自動化檢測系統，包含有：

- 一置料區，設於鍍膜設備之一端；
- 一進料減壓區，具有一減壓腔室，該減壓腔室的兩端各設有閘門，其中一閘門與該置料區連接；
- 一真空鍍膜區，具有一真空腔室，該真空腔室的一端與該進料減壓區的減壓腔室連接；
- 一出料增壓區，具有一增壓腔室，

該增壓腔室的一端與該真空鍍膜區之真空腔室連接；

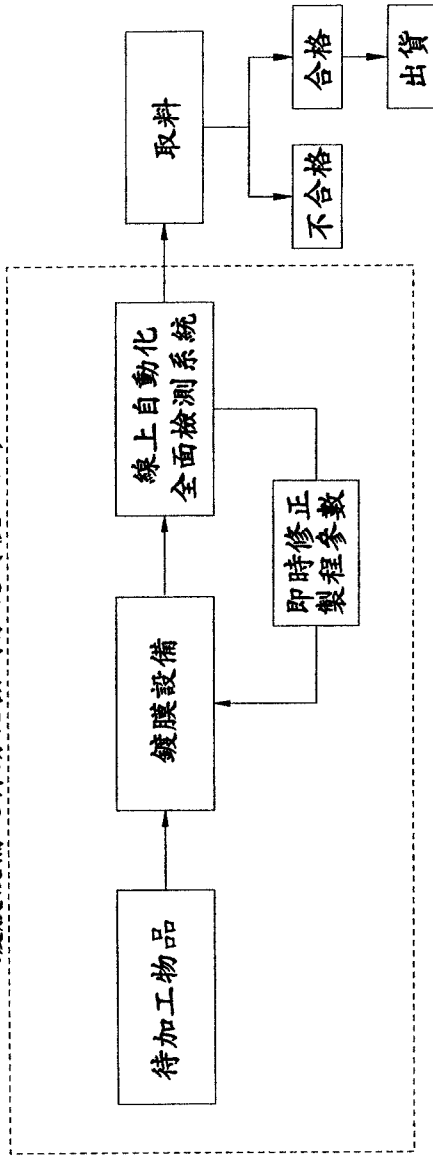
- 一檢測區，一端與該出料增壓區的增壓腔室連接，該檢測區內設有一 CCD/CMOS 檢測器以及一分光差色器；
- 一取料區，一端與該檢測區連接；
- 一控制處理器，設於該鍍膜設備之一側。

10. 2.依據申請專利範圍第1項所述連續式

- 鍍膜設備之線上自動化檢測系統，其中該檢測區內設有一標準光源。
3. 依據申請專利範圍第 1 項所述連續式鍍膜設備之線上自動化檢測系統，其中該 CCD/CMOS 檢測器裝設於一三維可移動的平台上。
 4. 依據申請專利範圍第 1 項所述連續式鍍膜設備之線上自動化檢測系統，其中該分光差色器裝設於一三維可移動的平台上。
 5. 依據申請專利範圍第 1 項所述連續式鍍膜設備之線上自動化檢測系統，其中該控制處理器係用來設定 CCD/CMOS 檢測器或分光差色器可允許合格標準樣品品質參數值。
 6. 依據申請專利範圍第 1 項所述連續式鍍膜設備之線上自動化檢測系統，其中該控制處理器設有一警告訊息發送器。
 7. 依據申請專利範圍第 1 項所述連續式鍍膜設備之線上自動化檢測系統，其中該置料區內設有一移動機構。
 8. 依據申請專利範圍第 1 項所述連續式鍍膜設備之線上自動化檢測系統，其中該進料減壓區內設有一移動機構。
 9. 依據申請專利範圍第 1 項所述連續式

- 鍍膜設備之線上自動化檢測系統，其中該真空鍍膜區內設有一移動機構。
10. 依據申請專利範圍第 1 項所述連續式鍍膜設備之線上自動化檢測系統，其中該出料增壓區內設有一移動機構。
 11. 依據申請專利範圍第 1 項所述連續式鍍膜設備之線上自動化檢測系統，其中該檢測區內設有一移動機構。
 12. 依據申請專利範圍第 1 項所述連續式鍍膜設備之線上自動化檢測系統，其中該取料區內設有一移動機構。
 13. 依據申請專利範圍第 1 項所述連續式鍍膜設備之線上自動化檢測系統，其中該置料區前可設有一可除塵除靜電之清潔區。
 20. 圖式簡單說明：
 - 第一圖係為習知技術的製造流程圖。
 - 第二圖係為本發明之結構示意圖。
 - 第三圖係為本發明操作之流程圖。
 25. 圖。

鍍膜設備之自動化檢測系統 (模組化)



第三圖